

高純度半導体製造プロセス用精密圧力調整器

# L20シリーズ

RoHS 10対応製品

## 高圧標準流量タイプ

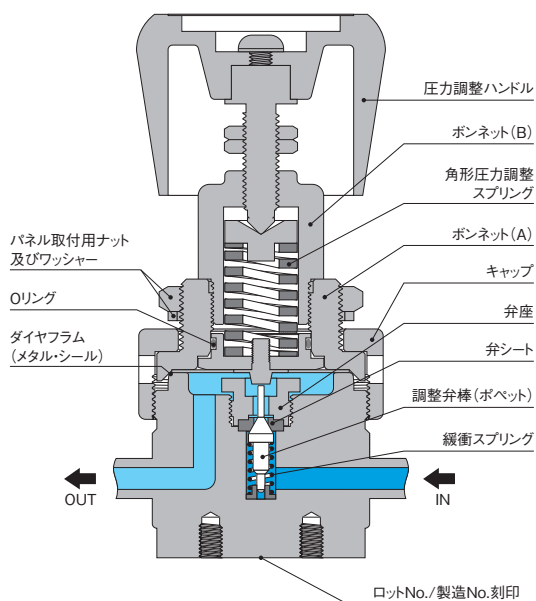
**特長**

■本器L20シリーズは、高圧タイプの半導体プロセス製造ガス用に設計された製品で基本構造は外部メタルシール・溶接継手仕様で外部リーク、パーティクル性能に優れた製品です。又、多種多様な高純度ガスに対応できるように豊富なオプションを揃えていますので、シリンダーキャビネットに最適です。

入口圧力	14.8MPa以下 (Max.19.6MPa)
調整圧力	Max.0.99MPa (レンジ仕様:0~0.2MPa、0~0.4MPa、0~0.6MPa、0~0.99MPa)
元圧変動	入口圧力:0.1MPa当り、調整圧力変化量0.00021MPa
耐圧圧力	22.2MPa (入口側)
Cv値	0.09
使用温度	-10~+40°C
外部リーク	$1 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s} \cdot \text{He}$ (真空法)
内部容積	4.67cm <sup>3</sup> (圧力計、継手部を除く)
質量	約1.29kg
取付方法	前面パネル取付用ナットまたは背面ビスによる取り付け (外観図参照)

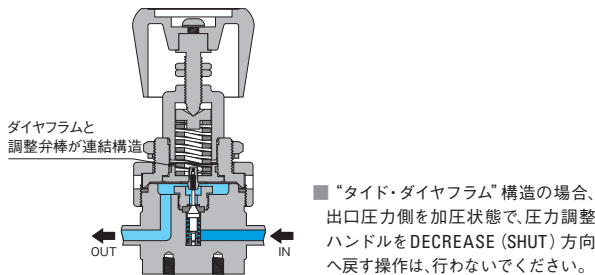


**構造図**

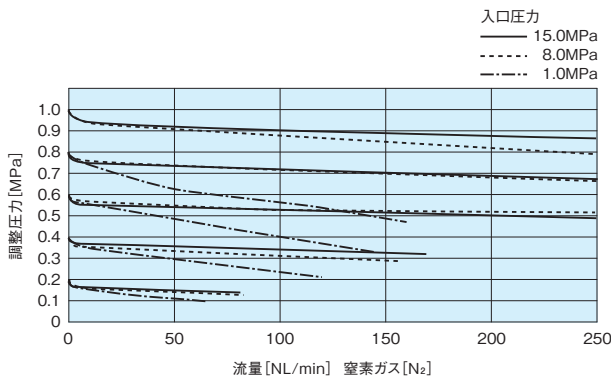


[備考]  
 ■圧力調整ハンドルは、必要以上に押し込まないように、ご注意ください。  
 ■本製品には、フィルターが内蔵されておりません。

**タイド・ダイアフラム構造 (オプション)**

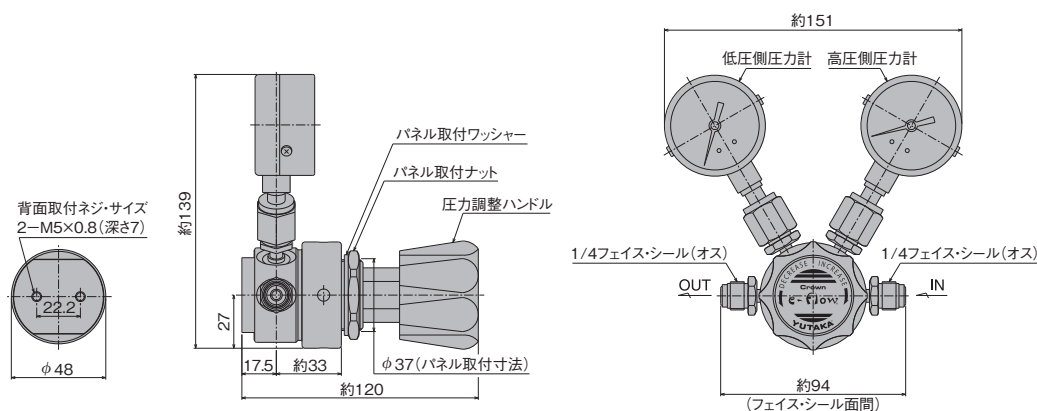


**流量曲線図**



[備考]  
 ■各流量曲線データは、標準仕様での参考値です。また、ガス温度等により変動します。

## 外観図



[備考]  
 ■単位:mm  
 ■各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 材質

タイプ	L20SS	L20SH	L20SS-CO
接ガス部			
本体	SUS316L		
調整弁棒・弁座	SUS316L	ハステロイ®C-22	SUS316L
ダイヤフラム	ハステロイ®C-22		SUS316L
弁シート	PCTFE (ダイフロン®)		
緩衝スプリング	SUS316	ハステロイ®	SUS316
圧力計部継手シール用ガスケット	Ni		SUS316
非接ガス部			
ボンネット (A)	SUS316		
ボンネット (B)	真鍮 (ニッケル・メッキ)		
キャップ	SUS304		
圧力調整ハンドル	ABS樹脂		
Oリング	NBR		

[備考]  
 ■タイプ:L20SS-COは、一酸化炭素(CO)ガス専用、材質が選定されております。他のガスには、ご使用されないようにお願いいたします。

## クリーン・レベル

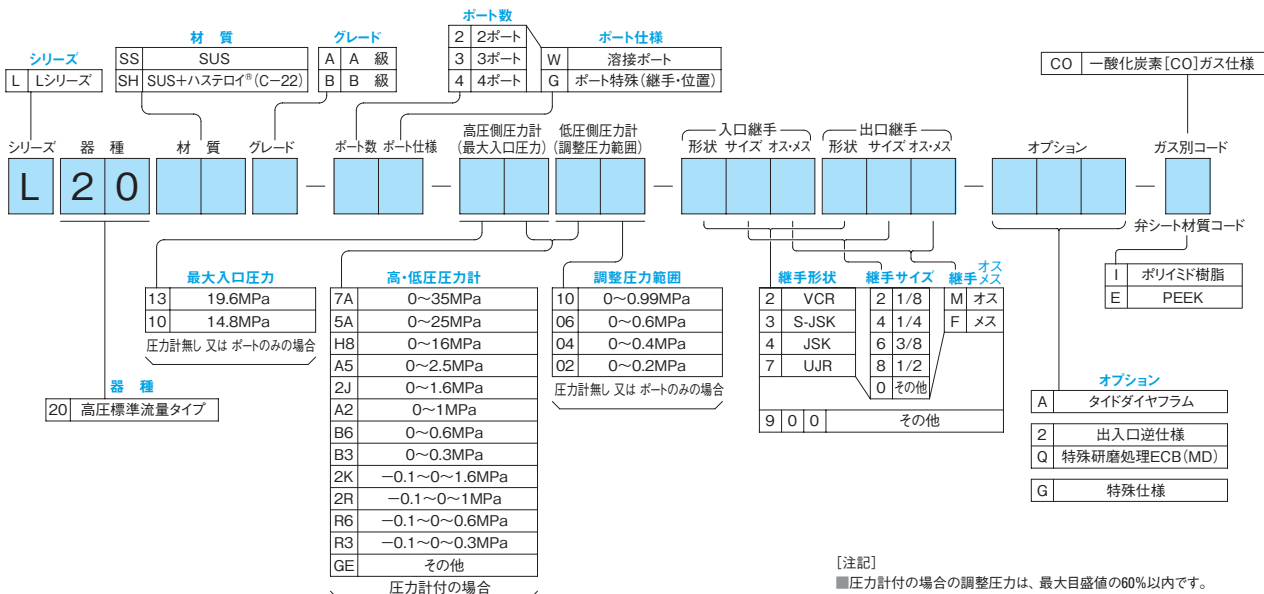
	非研磨仕様(グレード"B")	研磨仕様(グレード"A")
接ガス部表面処理	0.80μm Ra以下	0.18μm Ra以下

## 標準面間寸法

1/4"フェイス・シール継手面間寸法  
 (オス、メス同一)..... 約94 mm

[備考]  
 ■圧力計との接続は、フェイス・シール継手となり、出入口のサイズは1/4です。  
 ■入口・出口継手の種類・サイズおよび形状(オス、メス)の組み合わせは、品番コード表に示すものの中から選択可能です。  
 ■UJR®、VCR®、CVC®以外の継手の面間寸法は標準面間寸法と異なる場合があります。

## 品番コード



[注記]  
 ■圧力計付の場合の調整圧力は、最大目盛値の60%以内です。  
 ■入口圧力が19.6MPaの場合、調整圧力範囲0~0.2MPaは選定できません。